

(財) J K A 平成 22 年度公設工業試験研究所の設備拡充補助事業

FE-EPMA 分析装置 <日本電子株式会社/JXA-8530F>

< 概 要 >

工業材料等の微小領域における組織観察、定性分析、定量分析、面分析及び構造解析等を行う装置です。試料上の結晶方位解析を行うことができます。



< 仕 様 >

分 析 領 域： 90mm×90mm

二次電子像分解能： 3nm (30kv、 1×10^{-11} A、WD11mm)

WDS チャンネル数： 4チャンネル

最大試料寸法： 100mm×100mm×50mmH



この設備は競輪の補助金により整備されたものです。